

DIN EN 62047-10:2012-03 (D)

Halbleiterbauelemente - Bauelemente der Mikrosystemtechnik - Teil 10: Druckprüfverfahren an zylinderförmigen Mikroproben für Werkstoffe der Mikrosystemtechnik (IEC 62047-10:2011); Deutsche Fassung EN 62047-10:2011

Inhalt	Seite
Vorwort	2
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Symbole und Benennungen.....	4
4 Mikroprobe	5
4.1 Allgemeines.....	5
4.2 Form der Mikroprobe.....	5
4.3 Messung der Maße	5
5 Prüfdurchführung und Prüfeinrichtung	6
5.1 Prüfprinzip	6
5.2 Prüfeinrichtung	6
5.3 Prüfdurchführung.....	7
5.4 Prüfklima	7
6 Prüfbericht.....	8
Anhang A (informativ) Fehlerabschätzung mithilfe des Finite-Elemente-Modells (FEM)	9
A.1 Fehlerquellen.....	9
A.2 Finite-Elemente-Modell	9
A.3 Analyseergebnisse	9
Literaturhinweise	10
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen	11
Bilder	
Bild 1 – Form eines zylinderförmigen Stabs (siehe Tabelle 1 für die Symbole).....	4
Bild 2 – Prinzipdarstellung der Druckbeanspruchung auf eine zylinderförmige Mikroprobe.....	6
Bild A.1 – Fehlerschätzung mittels Aspektverhältnis und Reibungskoeffizient für die Ermittlung des Elastizitätsmoduls.....	9
Tabellen	
Tabelle 1 – Symbole und Benennungen zur Mikroprobe	5